

УДК 621.7

И.Р. Сагбиев. ВЧ плазменная модификация поверхности диэлектрических материалов и тонкопленочных покрытий. Казань, 2007. 29 с. (Препринт / Казан. гос. технол. ун-т)

В работе представлены результаты модификации поверхности диэлектрических материалов и тонкопленочных покрытий.

Исследовалась зависимость результатов ВЧ плазменной модификации поверхности материалов от входных параметров плазмотрона, основных параметров обработки – энергии ионов и плотности ионного тока в СПЗ, а также степени термической неравновесности.

Установлено, что плазменная модификация поверхности пленок позволяет улучшить их электрофизические и физико-механические свойства, а также уменьшать неровности их поверхности и увеличивать срок службы покрытий в 2 раза.

Ил. 8, табл.2.

Рецензенты: д.т.н. В.В.Хамматова
к.т.н. М.С.Пешкова

© И.Р. Сагбиев, 2007

© Казанский государственный
технологический университет, 2007